

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年4月7日(2005.4.7)

【公開番号】特開2001-210693(P2001-210693A)

【公開日】平成13年8月3日(2001.8.3)

【出願番号】特願2000-17223(P2000-17223)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/68

G 02 F 1/13

【F I】

H 01 L 21/68 A

G 02 F 1/13 101

【手続補正書】

【提出日】平成16年5月7日(2004.5.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1の液晶表示装置の製造装置は、基板を洗浄する洗浄処理室と、洗浄処理室で洗浄された基板に対して成膜処理を行う成膜処理室と、洗浄処理室から成膜処理室へ基板を外気にさらすことなく移送する外気遮断移送手段とを備える。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

請求項2の液晶表示装置の製造装置では、請求項1の装置において、外気遮断移送手段が、洗浄処理室から成膜処理室まで基板が移送される通路であって外気が遮断された外気遮断通路と、該外気遮断通路内において基板を搬送する搬送機とを備えている。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0011】

請求項3の液晶表示装置の製造装置では、請求項1の装置において、外気遮断移送手段は、洗浄処理室で洗浄された基板を外気にさらすことなく、外気と隔離可能な密閉カセット内に搬入する基板搬入手段と、成膜処理室において基板を密閉カセット内から取り出す基板取り出し手段とを備えている。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 1 3 】

請求項 4 の 液晶表示装置の製造装置 では、請求項 1 または 2 の装置において、カセットロード室と、搬送口ボットを有する搬送口ボット室（ロードロック室）とをさらに備え、カセットロード室、洗浄処理室および成膜処理室は、いずれも、搬送口ボットの周囲に配置され、搬送口ボットによって基板の出し入れができるよう搬送口ボット室と連絡している。